



● LULはご要望仕様に合わせたご提案が可能です。
We can propose the LUL following customer's requirement

大型個片/クォーターパネル
高精度検査装置

High accuracy inspection system for Large unit
and Quarter panel

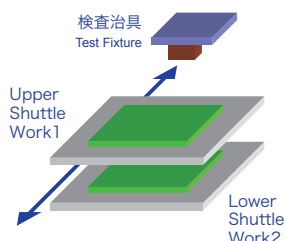
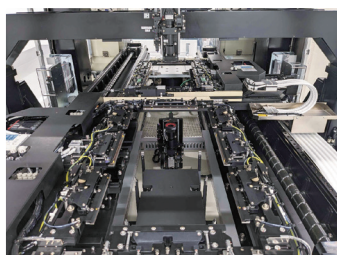
チップレットなどの大型・多ピン基板対応
For large size substrate like chiplet with many test points

多様なオートメーション要求に対応
Meet with various automation request

アドバンスドパッケージ対応導通絶縁検査装置 Advanced Package inspection system

総合アライメント精度 $\pm 2.5\mu\text{m}$
Comprehensive alignment accuracy $\pm 2.5\mu\text{m}$

上下ダブルシャトル式 Vertical Double Shuttle Mechanism



■ ダブルシャトル方式による高速検査
High-speed inspection by double shuttle mechanism

高速/高精度 OPEN/LEAK TESTER High speed and high accuracy Open/Leak tester



- 高速検査と高精度検査の両方を実現！
High speed and high accuracy inspection!
- 低抵抗から高抵抗の導通・短絡検査をカバーするワイドレンジ測定
OPEN/LEAK inspection with a wide range resistance.

Key Specification

検査部 Inspection section	Step & Repeat mechanism
Maxピン数 Maximum Test point	Top/Bottom: 32,768ch (4Kch*8QD-Block)
ワークサイズ Work Size	Unit □120~160mm Quarter (W)220~250*(D)230~300mm
ワーク厚み Thickness	Unit 0.5~3.0mm Quarter 0.4~3.3mm
KOZ(MIN)	6.0mm
総合アライメント精度 Alignment accuracy	+/-2.5 μm
ワークホルダ Work Holder	4-sided clamp/Tension mechanism
プレス能力 Press capability	Upper / Lower: max 200kgf
装置サイズ(想定) Equipment size (expected)	(W)1,920*(D)2,400*(H)2,200mm (Without L/UL)

※開発中の装置につき、実際の仕様とは異なる場合があります。
This system is under development, so the actual machine specification could be changed.